

Polissage Optique

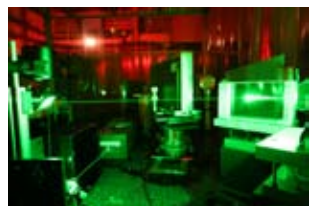
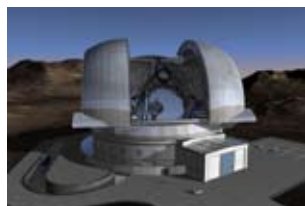
pour les Grands Instruments de la Physique et de l'Astronomie

11 juin 2009 - Bordeaux

Programme

9 h 00 - 9 h 15	Accueil	13 h 45 - 14 h 05	Challenges pour les grands composants optiques: fabrication, contrôle et analyses <i>Jean-Jacques Fermé (SESO)</i>
9 h 15 - 9 h 25	Introduction <i>Jérôme Neuport (CEA CESTA / DLP)</i>	14 h 05 - 14 h 25	Polissage et métrologie des grands composants optiques dans le domaine de l'astronomie et des lasers <i>Eric Ruch (SAGEM)</i>
9 h 25 - 9 h 50	Lasers de puissance et composants optiques <i>Bruno Le Garrec (CEA CESTA / DLP)</i>	14 h 25 - 14 h 45	Polissage de grands miroirs chez WINLIGHT <i>Philippe Godefroy (WINLIGHT)</i>
9 h 50 - 10 h 15	Besoins en surfacage optique pour les futurs grands télescopes ELTs <i>Marc Ferrari (LAM / OAMP)</i>	14 h 45 - 15 h 05	Le StarSiC, une alternative matériau pour les miroirs de grandes dimensions <i>François Abbé (Snecma Propulsion Solide)</i>
10 h 15 - 10 h 40	Spécifications des grands composants lasers et métrologie optique associée <i>Jérôme Daurios (CEA CESTA / DLP)</i>	15 h 05 - 15 h 20	Pause
10 h 40 - 11 h 00	Pause	15 h 20 - 15 h 45	Modélisation des phases de doucissage et de polissage de la silice par éléments discrets <i>Damien André (LAMEFIP)</i>
11 h 00 - 11 h 25	Spécifications des erreurs de surfaces en terme Pupil PSD <i>Kjebi Dohlen (LAM / OAMP)</i>	15 h 45 - 16 h 10	Techniques de polissage sur lames de phase pour mise en forme spatiale de tache focale <i>Philippe Cormont (CEA CESTA / DLP)</i>
11 h 25 - 11 h 50	Endommagement laser UV de la silice polie – Rôle des micro-fractures – métrologie des micro-fractures et effet des procédés <i>Jérôme Neuport (CEA CESTA / DLP)</i>	16 h 10 - 16 h 35	Polissage d'une grande lame mince par méthode active pour le VLT <i>Marc Ferrari (LAM / OAMP)</i>
11 h 50 - 12 h 15	Méthode de polissage sous contraintes appliquées aux grands composants, modélisation par éléments finis <i>Emmanuel Hugot (LAM / OAMP)</i>	16 h 35 - 17 h 00	Optimisation de la phase d'usinage de la silice pour application laser de puissance <i>Jean-Philippe Champreux (LMP)</i>
12 h 15 - 13 h 45	Déjeuner buffet	17 h 00 - 17 h 15	Conclusion de la journée <i>Jérôme Neuport (CEA CESTA / DLP) et Marc Ferrari (LAM / OAMP)</i>

Orange : grands projets lasers de puissance (LIL, LMJ, PETAL, ...)
Bleu : grands instruments terrestres et spatiaux (ELT, ...)



www.rdv-routedeslasers.com/polissage

un rendez-vous de la Route des Lasers